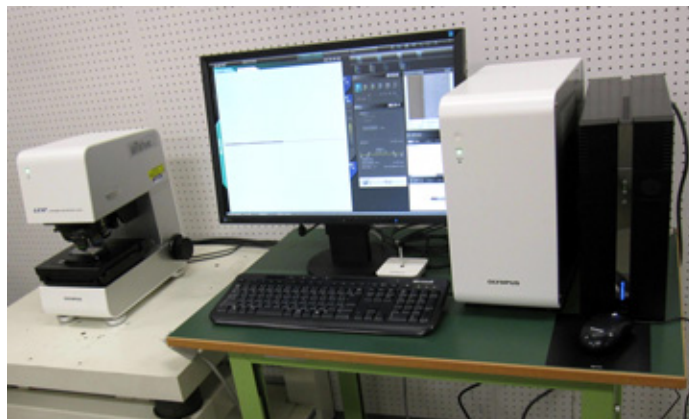


設備紹介 - レーザー顕微鏡

平成24年度補正予算事業「地域新産業創出基盤強化事業」(近畿地域)により「3D測定レーザー顕微鏡」を新規に設置しました。本装置は、青紫色半導体レーザーを用いて試料表面の微細な凹凸を高精細でかつ高速に観察・測定する装置です。また電動ステージとの連動で、最大100mm角の試料表面を観察することができます。太陽電池、金属、プラスチック等、幅広い分野に応用することができます。



概要

1. 品名	レーザー顕微鏡
2. システム構成	オリンパス(株)製 OLS4000-SAT
3. 特長	<ul style="list-style-type: none"> ・光源 405nm半導体レーザー ・総合倍率 108× ~ 17280× ・測定精度(平面測定) 繰り返し性:0.02μm(3σ、100×) 正確さ :測定値の±2%以内 ・測定精度(高さ測定) 繰り返し性:0.012μm(σ、50×) 正確さ0.2+L/100μm(L=測定長μm) ・XYステージ 100×100mm (電動ステージ) ・測定モード 段差測定、線粗さ測定、面粗さ測定、幾何測定、面積/体積測定
4. 応用例	<ul style="list-style-type: none"> ・太陽電池の表面観察・測定 ・金属、プラスチック等の材料、部品、製品の表面観察・測定

掲載日付: 2013年12月27日